

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】令和 3 年 2 月 25 日 (2021.2.25)

【公開番号】特開 2019-125573 (P2019-125573A)

【公開日】令和 1 年 7 月 25 日 (2019.7.25)

【年通号数】公開・登録公報 2019-030

【出願番号】特願 2018-220391 (P2018-220391)

【国際特許分類】

H 0 5 B 6/64 (2006.01)

H 0 5 B 6/74 (2006.01)

H 0 5 B 6/80 (2006.01)

D 0 6 B 19/00 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 6/64 D

H 0 5 B 6/74 A

H 0 5 B 6/80 Z

D 0 6 B 19/00 B

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 1 月 13 日 (2021.1.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

内部を処理対象物が移動する容器と、当該容器内にマイクロ波を照射する照射部を備えたマイクロ波照射手段と、前記容器内に前記処理対象物の移動経路に沿って該処理対象物を覆うように設けられると共に前記マイクロ波照射手段から照射されるマイクロ波を吸収して発熱する発熱部材と、を備えたマイクロ波処理装置であって、
前記照射部が照射するマイクロ波の強度が前記発熱部材において強くなる第一のマイクロ波照射位置と、前記照射部が照射するマイクロ波の強度が前記処理対象物において強くなる第二のマイクロ波照射位置とが前記処理対象物の移動経路に沿って設けられているマイクロ波処理装置。